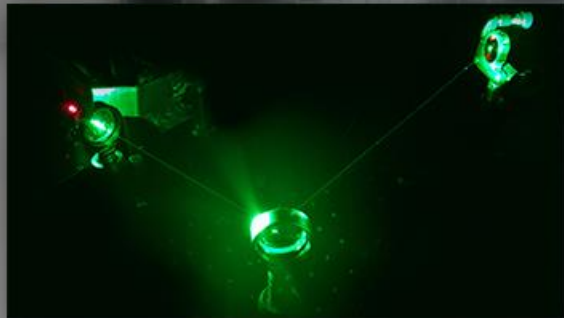
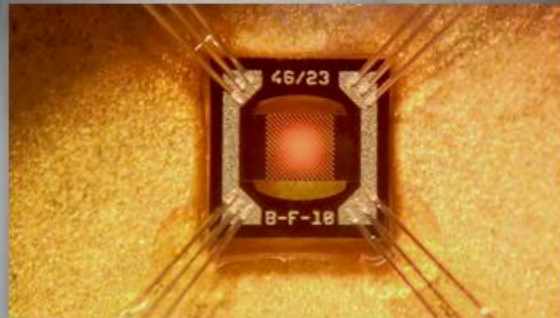


Workshops 2020

Quanten-
Technologien



MOEMS:
NDIR-Sensorik



MEMS:
Drucksensorik



COVID-19 Hinweise / COVID-19 Remarks

Aktuell gehen wir davon aus, dass wir unsere drei Workshops wie geplant mit persönlichem Kontakt unter Berücksichtigung aller vorgeschriebenen Schutz- und Hygiene-Maßnahmen in Erfurt durchführen werden. Nichtsdestotrotz sind wir uns bewusst, wie dynamisch die Entwicklungen um COVID-19 sind. Deshalb beschäftigen wir uns ebenfalls mit Optionen für eine Umsetzung als Online-Workshop.

Sollten sich Änderungen am Format ergeben, informieren wir uns bekannte Interessenten per E-Mail bzw. finden Sie aktuelle Informationen auch auf den Workshop-Webseiten www.cismst.de/workshops/

At present, we are assuming that we will be holding our three workshops in Erfurt as planned with personal contact, taking into consideration all the mandatory protection and hygiene precautions. Nevertheless, we are aware of how dynamic the developments around COVID-19 are. Therefore we are also looking at options for an online-based realization.

Should there be any changes in the format, we will inform known interested participants by e-mail or you can find current information on the workshop web pages www.cismst.de/workshops/



CiS Workshops 2020

Veranstaltungspartner / Event partner



Veranstalter / Organizer



CiS MEMS Workshop 2020

Drucksensorik

29.10.2020 in Erfurt, Germany

www.cismst.de/workshops/

Über die Veranstaltung



Am 29. Oktober 2020 findet in Erfurt ein Workshop zum Thema **Drucksensorik** statt.

Es erwarten Sie spannende Vorträge aus dem CiS Forschungsinstitut sowie von Vertretern aus Forschung und Industrie mit den Themenschwerpunkten:

- Sensoranforderungen
- Sensorkonzepte und -design
- Sensormontage
- Mess- und Analyseverfahren

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich mit anderen Experten zu vernetzen und sich über aktuelle Entwicklungstrends auf den neuesten Stand zu bringen.

WORKSHOP AGENDA - MEMS Drucksensorik

09:30 Registrierung & Get Together

10:00 Begrüßung

10:30 Keynote

11:00 **SESSION I - Entwicklung von Sensorelementen**

12:40 Mittagspause

13:30 **SESSION II - Montage von Sensoren**

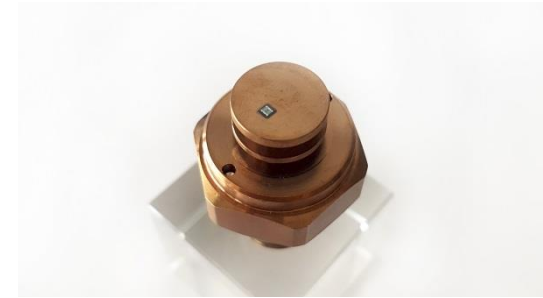
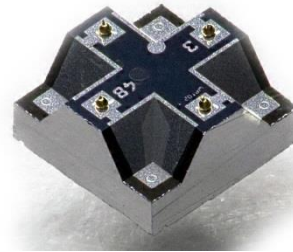
15:10 Kaffeepause

15:40 **SESSION III - Prüftechnik & neuartige Anwendungen**

16:30 Discussion / Brainstorming

17:00 Conclusion

17:15 Ende der Veranstaltung



WORKSHOP AGENDA - MEMS Drucksensorik

09:30 **Registrierung & Get Together**

10:00 Begrüßung

Prof. Thomas Ortlepp, CiS Forschungsinstitut

10:30 **Keynote:** Waferbondverfahren für Drucksensoren

Roy Knechtel, Hochschule Schmalkalden

SESSION I: Entwicklung von Sensorelementen

11:00 Piezoresistive Drucksensoren für Anwendungen bis 300 °C

Michael Blech, CiS Forschungsinstitut

11:25 Innovative Technologien für piezoresistive Drucksensoren

Uwe Güldenpfennig, ETO SENSORIC GmbH

11:50 Einsatz von SiCer-Verbundsubstraten für Drucksensoren

Cathleen Kleinholz, TU Ilmenau und Andrea Cyriax, CiS Forschungsinstitut

12:15 Contributions of Structured Glass Wafers to improved and next generation pressure sensor dies

Ulrich Peuchert, Schott AG

12:40 **Mittagspause**

SESSION II: Montage von Sensoren

13:30 Glasfritte-Bondtechnologien zum Aufbau hochstabiler Kraftsensor-Systeme

Andre Grün, CiS Forschungsinstitut

13:55 Flip-Chip Montage von piezoresistiven Drucksensoren

Olaf Skerl, BIOTRONIK SE & Co. KG

14:20 Einflüsse der unterschiedlichen AVT-Komponenten auf das Hystereseverhalten von Drucksensoren

Jens Scherbel, Lust Hybrid-Technik GmbH

14:45 Miniaturisierung von (Druck-)Sensoren mit Direktumspritzung

Arthur Rönisch, Turck duotec GmbH

15:10 **Kaffeepause**

SESSION III: Prüftechnik & neuartige Anwendungen

15:40 Innovatives Gassensorsystem für H₂-Konzentrationen bis 100% und 100 bar Einsatzdruck
Olaf Kiesewetter, UST Umweltsensortechnik GmbH

16:05 Charakterisierung von Si-Drucksensoren
Stefan Jagomast, CiS Forschungsinstitut

16:30 Discussion / Brainstorming

17:00 Conclusion

Ende des Workshops



Allgemeine Informationen für den MEMS Workshop

Registrierung

Bitte registrieren Sie sich online auf der Internetseite:

www.cismst.de/workshops/mems-2020/

Die Anmeldegebühr beträgt 150 € für die Teilnahme inklusive Mehrwertsteuer.

Bezahlung

Bitte überweisen Sie die Anmeldegebühr auf folgendes Konto:

Kontoinhaber: CiS e.V.

Bank: Sparkasse Mittelthüringen

IBAN: DE37 8205 1000 0130 1134 25

BIC: HELADEF1WEM

Verwendung: MEMS2020

Organisation

Die gesamte Korrespondenz zum Workshop richten Sie bitte an folgende Adresse:

CiS e.V.

Frau Uta Neuhaus
Konrad-Zuse-Str. 14
99099 Erfurt

Telefon: +49 361 663 1160

Fax: +49 361 663 1413

E-Mail: veranstaltung@cismst.de



Veranstaltungsort

CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik
AZM - Anwendungszentrum für Mikrosystemtechnik
Konrad-Zuse-Str. 14
99099 Erfurt

Sie reisen nach Erfurt ...

...via **Flugzeug** nach Frankfurt oder Berlin

...mit dem **Auto** via Autobahn A71 und/oder A4, Ausfahrt Erfurt Ost

...mit dem **Zug** zum Erfurter Hauptbahnhof und dann Straßenbahn

Nummer 3, Richtung "Urbicher Kreuz", bis Haltestelle "Windischholzhäuser/ X-Fab" bis zu Fuß bis zum AZM bzw. CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH

Der Workshop findet im Konferenzraum des AZM in der 3. Etage statt.

Ihre Anreise zum Tagungsort

- Auto** A4 oder A71
- Bahn** Erfurt Hauptbahnhof, Straßenbahn Linie 3
- Flugzeug** Flughafen Erfurt Weimar (ERF)

